

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

### Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 24.11.2021

Ausstellungsdatum: 24.11.2021

Urkundeninhaber:

**TASCON Gesellschaft für Oberflächen- und Materialcharakterisierung mbH  
Mendelstraße 17, 48149 Münster**

an den Standorten:

**Mendelstraße 17, 48149 Münster  
Otto-von-Guericke-Ring 13, 65205 Wiesbaden Nordenstadt**

Prüfungen in den Bereichen:

**physikalisch-chemische Analyse der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) und Photoelektronenspektroskopie (XPS/ESCA); Bestimmung der Rauigkeit von Oberflächen mittels optischer Profilometrie**

*Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.*

*Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>*

Innerhalb der mit \*\* gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiterentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft.

Innerhalb der mit \*\*\* gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden:

MS = Münster

WB = Wiesbaden

**1 Bestimmung der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) \*\***

VA-OG-AM-ToF-SIMS-Spektrenakquisition / Rev. 3 2017-02/ 3	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Spektrometrie	MS
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Imageakquisition / Rev. 3 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Imaging	MS
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Tiefenprofilakquisition / Rev. 2 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Tiefenprofilierung	MS
VA-OG-AB-ToF-SIMS-Quantifizierung-von-B-in-Si / Rev. 2 2017-02	Quantitativer Nachweis von Bor in Silizium (ToF-SIMS)	MS